



XR66

小形圧力調整弁

Model XR66 Compact Pressure Regulator

概要

半導体用プロセスのユースポイントで使用できる小形圧力調整弁です。接続は、各種ネジ継手タイプと1.5集積用があります。

特長

- ・小形ながら標準流量が20L/min.^{※1}、最大流量が50L/min.と比較的大きな流量を実現いたしました。
(ネジ継手タイプ)
- ・内容量が約3.7mLと少なく、接ガス部はウルトラクリーン(UC)処理を行っております。
- ・接ガス部にはアウトガス、パーティクルの発生源となるねじはありません。
- ・外部シールは全てメタルシートになっています。
- ・ダイアフラムにハステロイC-22相当を採用し耐食性と耐久性を向上させています。

※1 弊社基準です。(詳細は流量特性をご覧ください)

※接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることをご確認下さい。

製作仕様

制御流体：各種半導体プロセスガス

一次圧力：1MPa

継手形状	ネジ		集積タイプ	
	0.05~0.3	0.05~0.7	0.05~0.3	0.05~0.5
二次圧力 (MPa)				
常用流量 (L/min)	20		15	40
	一次圧力：1MPa	一次圧力：1MPa	一次圧力：1MPa	一次圧力：1MPa
	二次圧力：0.3MPa	二次圧力：0.7MPa	二次圧力：0.3MPa	二次圧力：0.5MPa
	0.05MPa降下時	0.1MPa降下時	0.05MPa降下時	0.1MPa降下時
最大流量 (L/min)	50		70	
	一次圧力：1MPa	一次圧力：1MPa	一次圧力：1MPa	一次圧力：1MPa
	二次圧力：0.3MPa	二次圧力：0.7MPa	二次圧力：0.3MPa	二次圧力：0.5MPa

耐 圧：1.5MPa

気密性： 1×10^{-11} Pa・m³/sec以下 (He真空法)

接ガス部表面処理：ウルトラクリーン(UC処理)
表面粗さ0.7μmRy以下 (0.1μmRa以下)

パーティクル：弊社検査基準において0.1μm以上の粒子が
ノーカウント

使用温度範囲：-5~40℃ (氷結、結露なきこと)

保存温度範囲：-5~50℃ (氷結、結露なきこと)

接続継手：1/4UJR、1/4VCR、1/4CVC、1.5 W-Seal (集積化対応)

取付方法：M5 取付穴ネジ 1.5集積マウント

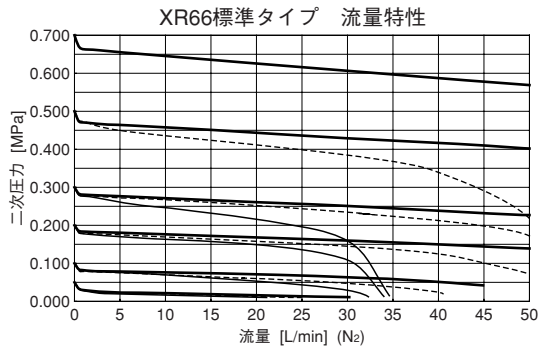
接ガス部材質：本体 SUS316L[®]
ダイアフラム ハステロイC-22相当
弁バネ SUS316
弁シート CTFE[®]
弁 ハステロイC-22相当

内 容 量：約3.7mL

質 量：約0.47kg

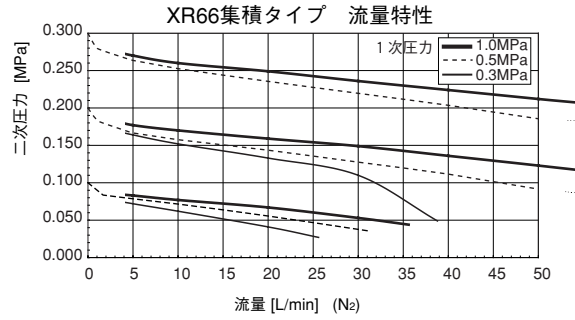
流量特性

(1) 標準タイプ

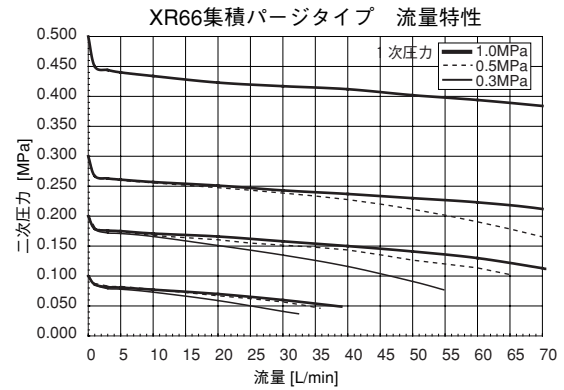


一次圧力
 — 1.0MPa
 - - - 0.5MPa
 — 0.3MPa

(2) 集積タイプ

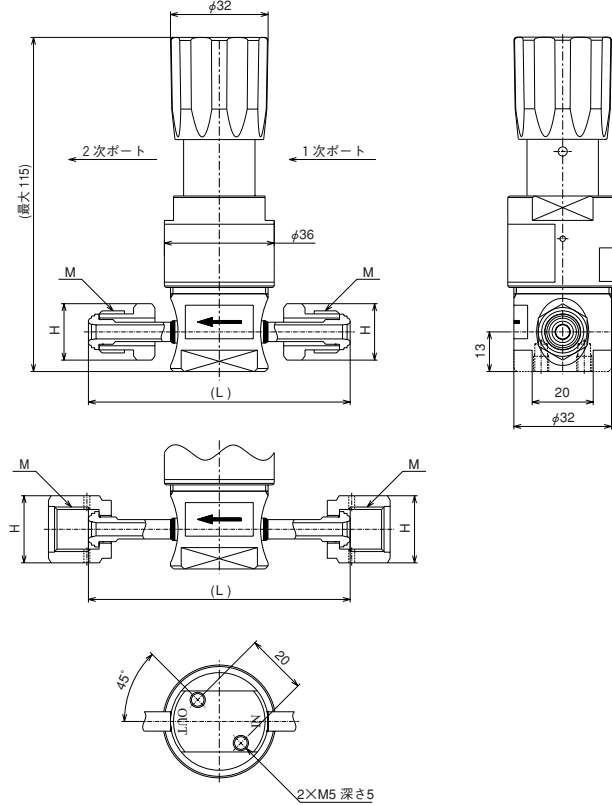


(3) 集積パージタイプ

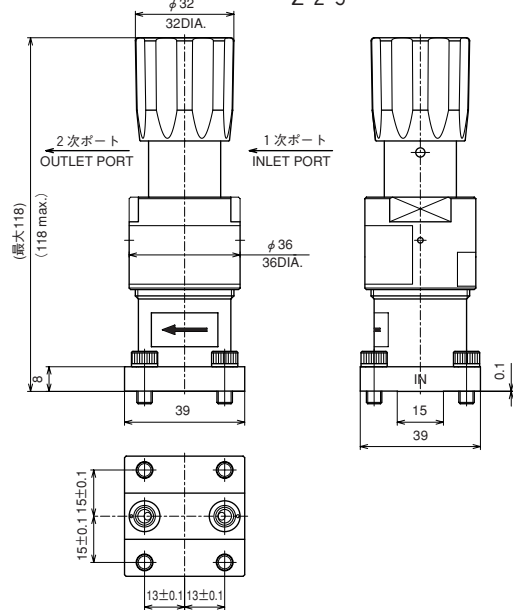


外形寸法

ネジ接続
 XR66-0□1



集積タイプ、集積パージタイプ
 XR66-Z20
 Z25



形番	接続継手	配管径	ネジサイズ M	寸法	
				H	(L)
XR66-0J1	VCRオスナット	1/4	9/16-18UNF	16X18.5六角	85.8
XR66-0L1	VCRメスナット*	1/4	9/16-18UNF	19X21.9六角	85.8
XR66-0N1	UJRオスナット	1/4	9/16-18UNF	17X19.6六角	92
XR66-0Q1	UJRメスナット (ピュアリング入)	1/4	9/16-18UNF	19X21.9六角	92
XR66-0W1	CVCオスナット	1/4	9/16-18UNF	15.8X18.2六角	85.8
XR66-0Y1	CVCメスナット*	1/4	9/16-18UNF	19X21.9六角	85.8

*ベアリングは入っておりません。

